

電気通信大学研究設備センター基盤研究設備部門表面・界面構造解析室、化学構造解析室及び分析・計測機器室使用内規

(趣旨)

第1条 この内規は、電気通信大学研究設備センター規程第12条の規定に基づき、電気通信大学研究設備センター（以下「センター」という。）基盤研究設備部門に置かれる表面・界面構造解析室、化学構造解析室及び分析・計測機器室に属する機器（以下「機器」という。）の使用に関し、必要な事項を定める。

(使用の資格)

第2条 機器を使用することができる者は、本学の専任教員または専任教員の指導を受けて研究に従事する者で、かつ当該室が認める機器に関する講習等を修了した者とする。

(使用の手続き)

第3条 使用希望者は、あらかじめセンターに利用登録を行い、機器ごとに定められた機器管理責任者（以下「管理者」という。）の承認を受けるものとする。

2 機器の使用は、前項の承認を受けた後、管理者と調整の上、予約システムにより使用時間の予約を行った上で行うものとする。

(使用の方法)

第4条 機器の使用時間は、管理者が割り当てる。

2 機器の運用時間は、機器ごとに定めるが、原則として10時から17時までとする。

第5条 機器の調整及びこれに伴う操作は、原則として使用者において行うものとする。

第6条 機器及び附属装置等の取扱いについては、管理者の管理の下に行うものとする。

(使用料)

第7条 使用者は、各室の定める基準により使用料として所要経費を負担する。

(健康管理等)

第8条 機器のうちX線機器、電子顕微鏡等、放射線の発生を伴う機器を使用する者は、使用時における放射線の漏洩線量を測定しなければならない。

2 前項の機器を使用する者は、別に定める健康診断を定期に受けなければならない。

(雑則)

第9条 この内規に定めるもののほか、各室の機器及び附属装置等の使用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

附 則

1 この内規は、平成21年4月1日から施行する。

2 電気通信大学機器分析センター表面・界面構造解析室、化学構造解析室及び分析・計測機器室使用内規（平成16年4月1日施行）は、廃止する。